附录C

高度控制测量过程有效性确认记录

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量过程编号 | CL01 | 测量过程名称 | 涂层厚度检测 | 测量过程规范编号 | CVVT/JS-CL-02 |
| 所在部门 | 质量部 | 测量项目 | 涂层厚度检测 | 控制程度 | 高度控制 |
| 测量过程要素概述：测量设备：UT343D涂层测厚仪测量方法：厚度测量采用直接测量，UT343D涂层测厚仪直接在已有涂层的工件表面，涂层测厚仪显示被测量数据，并记录。环境条件：常温测量软件：无操作者技能：仪器操作人员，经培训合格。其他影响量：无 |
| 有效性确认记录:用251μm标准厚度试片对涂层测厚仪的检测过程的有效性进行确认：2022年9月13日用涂层测厚仪对标准厚度试片对进行五次厚度检测，平均厚度为251μm2022年9月14日用涂层测厚仪对标准厚度试片对进行五次厚度检测，平均厚度为252μm公司的涂层测厚仪的测量过程的不确定为U=10.6μm k=2E= = 1/（1.414\*10.6）=0.067≤1 当E≤1时，此测量过程有效。8849daa89a64d38b080c4d929bc2dd7确认人员： 日期：2022-9-14 |
| 变更记录: |
| 日期 | 变更内容 | 批准人 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |